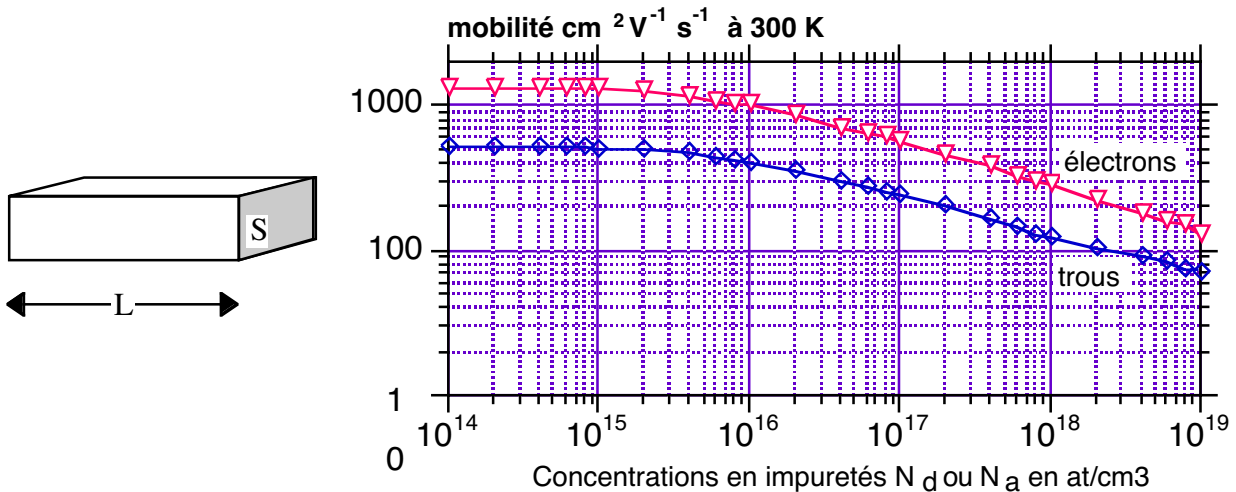
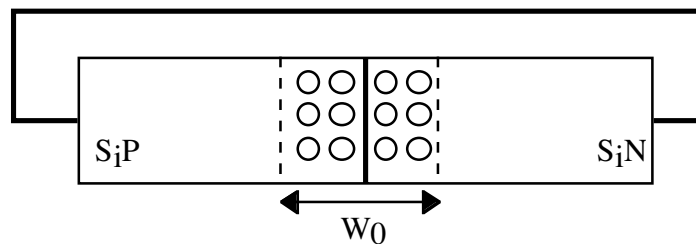


DERIVE EN TEMPERATURE DE LA BARRIERE DE POTENTIEL D'UNE JONCTION P N

On considère à la température $T = 300\text{ K}$, deux barreaux de silicium de dimensions identiques ($L = 100\text{ mm}$, section $S = 100\text{ mm}^2$). L'un est uniquement dopé au bore ($N_a = 10^{16}\text{ atomes cm}^{-3}$) et l'autre uniquement au phosphore ($N_d = 10^{17}\text{ atomes cm}^{-3}$). On donne la concentration intrinsèque du silicium à 300 K : $n_i = 1.45 \cdot 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ et le graphe indiquant l'évolution de la mobilité des porteurs en fonction du dopage.



- 1) Déterminer à 300 K la densité de population des porteurs libres dans chaque barreau ainsi que la résistance correspondante entre les extrémités séparées par la longueur L (on justifiera les approximations utilisées).
 - a) Barreau dopé P
 - b) Barreau dopé N
- 2) On met en contact les deux barreaux de manière à former une jonction PN. Cette jonction est par ailleurs court-circuitée.



- a) Indiquer sur la figure où se trouvent l'anode et la cathode du dispositif.

De part et d'autre de la zone de contact, il se crée une charge d'espace, d'épaisseur W_0 , constituée par une répartition uniforme d'ions de bore et de phosphore.

- b) Commenter le phénomène qui est à l'origine de la présence de ces ions.
- c) Indiquer sur la figure le signe de la charge électrique des ions bore et phosphore.
- d) Sans faire de calcul, quel est l'ordre de grandeur de l'épaisseur W_0 de la Z.C.E.?

Les ions fixes de la Z.C.E. forment deux couches de charges qui créent une barrière de potentiel V_ϕ jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement de la jonction. On donne l'expression de V_ϕ :

$$V_\phi = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) \quad (1)$$

k constante de Boltzman, q : charge élémentaire.

La barrière de potentiel V_ϕ dépend de la température par l'intermédiaire de la variable T d'une part et de la concentration intrinsèque du silicium n_i d'autre part.

Sachant qu'on s'intéresse à la variation dV_ϕ de la barrière de potentiel avec la température, on doit écrire une différentielle totale :

$$dV_\phi = \left[\frac{\partial V_\phi}{\partial T} \right]_{n_i \text{ constant}} dT + \left[\frac{\partial V_\phi}{\partial n_i} \right]_{T \text{ constant}} dn_i$$

3) Déterminer dans ces conditions l'expression de la variation dV_ϕ .

4) On donne l'expression de la concentration intrinsèque n_i du silicium :

$$n_i = A T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_G}{2kT}\right) \quad (2)$$

où A est une constante et E_G représente la hauteur de bande interdite du silicium. En effectuant une différentielle logarithmique déterminer l'expression $\frac{dn_i}{n_i}$ sachant que la température est variable.

5) En déduire en utilisant le résultat de la question 3, l'expression de la dérive en température de la barrière de potentiel V_ϕ c'est-à-dire : $\frac{dV_\phi}{dT}$.

6) Faire l'application numérique à $T = 300$ K sans oublier l'unité de $\frac{dV_\phi}{dT}$.

On donne $E_G = 1,12 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$ J , $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹ et $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

CORRECTION

1) On exploite les relations suivantes :

- Loi d'action de masse : $p n = n_i^2$
- Conductivité: $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$
- Résistance : $R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{S}$

Barreau dopé P :

Densité population trous	Densité population électrons	Mobilité des trous	Résistivité	Résistance
$p = N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$	$2,1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$	$\mu_p = 400 \text{ cm}^{-2}\text{V}^{-1} \text{ s}^{-1}$	$1,563 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$	$15,63 \text{ k}\Omega$

Barreau dopé N :

Densité population trous	Densité population électrons	Mobilité des électrons	Résistivité	Résistance
$p = 2,1 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	$n = N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$	$\mu_n = 550 \text{ cm}^{-2}\text{V}^{-1} \text{ s}^{-1}$	$113 \cdot 10^{-3} \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$	$1,13 \text{ k}\Omega$

2) Voir le cours : théorie générale des semi-conducteurs.

3) Calcul des dérivées partielles de la relation (1) :

- $\left(\frac{\partial V_\Phi}{\partial T}\right)_{n_i \text{ ct}} = \frac{k}{q} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$
- $\left(\frac{\partial V_\Phi}{\partial n_i}\right)_{T \text{ ct}} = \frac{kT}{q} \left(-\frac{2}{n_i}\right)$

$$dV_\Phi = \frac{k}{q} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) dT - \frac{2kT}{q} \frac{dn_i}{n_i} \quad \text{ou encore : } dV_\Phi = \frac{V_\Phi}{T} dT - \frac{2kT}{q} \frac{dn_i}{n_i}$$

4) Dérivée par rapport à n_i de la relation (2) : $n_i = A T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$

$$\ln(n_i) = \ln(A) + \frac{3}{2} \ln(T) - \frac{E_g}{2kT}$$

$$\frac{dn_i}{n_i} = \frac{3}{2} \frac{dT}{T} + \frac{E_g}{2k} \frac{dT}{T^2}$$

5) Expression de la dérive en température de la barrière de potentiel V_Φ .

$$dV_\Phi = \frac{V_\Phi}{T} dT - \frac{2kT}{q} \left(\frac{3}{2} \frac{dT}{T} + \frac{E_g}{2k} \frac{dT}{T^2}\right)$$

$$\frac{dV_\Phi}{dT} = \frac{V_\Phi}{T} - \frac{3k}{q} - \frac{E_g}{qT}$$

6) Application numérique : $V_\Phi = \frac{k}{q} \ln\left[\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right] = 755,4 \text{ mV}$

$$\frac{dV_\Phi}{dT} = -1,47 \text{ mV } K^{-1}$$